DR. GOTTWALD PÉTER BME Elektronikus Eszközök Tanszék DR. AMBRÓZY ANDRÁS BME Elektronikai Technológia Tanszék

Adalékeloszlás mérése vékony GaAs és Si epitaxiális rétegekben

ETO 537.311.322:621.382.08

(4)

A különböző rendeltetésű és specifikációjú félvezető eszközeink előállítása közben változatos adalékatomeloszlást hozunk létre egy kristálylapka belsejében.

Modern eszközeinkben már 1 μ m³-nyi térfogaton belül is sokat változhat az adalékatomok sűrűsége. A jövőben az eszközméretek tovább csökkennek, s az adalékeloszlás részletgazdagsága fokozódik.

- Az eszközméretek csökkentésének két oka van:
- a) ezáltal növelhető az eszközök működési sebessége,
- b) így növelhető a félvezető lapkán az elemsűrűség, a kristályhibák sűrűségéhez képest.

A. Möschwitzer a legkisebb struktúra lineáris méretét az ezredfordulóra 0,1 μ m-re becsüli [1]. Ez nagyobb, mint az alapanyagatomok sűrűsége által meghatározott, fizikailag még elképzelhető legkisebb struktúra mérete, tehát a meghatározó tényező még az ezredfordulón is a technológia lesz.

A méretcsökkenés nemcsak a technológiát, hanem a méréstechnikát is nagy feladatok elé állítja. A sokféle, párhuzamosan létező adalékelosztás mérési módszer egyike sem tökéletes; ezért is léteznek egyidejűleg. A szakirodalom részletesen elemzi őket [2], [3], [4], [5].

A Budapesti Műszaki Egyetemen kifejlesztett adalékeloszlás-mérő berendezés működésmódját, főbb paramétereit, valamint a tervezés egyes szempontjait az alábbiakban ismertetjük a [2] publikációhoz csatlakozva.

A mérés elméleti alapjai

A berendezés a jól ismert "C–V-módszer" [6] alapján mér. Ennek lényege, hogy pl. egy p-n átmenet két oldalán az ionizált adalékatomok + Q és – Q töltést tartalmazó tértöltésréteget alkotnak. Záróirányban növekvő rétegfeszültséggel nő a tértöltésréteg szélessége, és mindkét oldalon Δ Q-val megváltozik a rétegben tárolt töltés (1. ábra).

Megadjuk az A felületű átmenet rétegkapacitásának definícióját és összefüggését a tértöltésréteg szélességével:

$$C(U_R) = \frac{dQ}{dU_R} = \varepsilon \cdot \frac{A}{w}.$$
 (1)

Itt ε a dielektromos állandó. Figyelembe véve, hogy

$$Q = AqN_D(w_n) \cdot w_n = AqN_A(w_p) \cdot w_p, \qquad (2)$$

Beérkezett: 1979. X. 12.

igazolható, hogy

$$\frac{dU_R}{dw} = \frac{q}{\varepsilon} \cdot N(w) \cdot w, \qquad (3)$$

ahol $N(w) = N_A(w_p) ||N_D(w_n).$

Gyakori az erősen aszimmetrikus átmenet. Például, ha általában:

$$N_{A}(w_{n}) \gg N_{D}(w_{n}),$$

$$w \approx w_n$$
, es $N(w) \approx N_D(w_n)$.

Gyengén aszimmetrikus átmenetekre C. Opdorp [6] adott meg N(w) függvényeket, meghatározott $N_A(w_p) \div N_D(w_n)$ párokra.

Az eddigiek alapján adódik, hogy:

$$\frac{1}{C} \cdot \frac{dC}{dU_R} = \frac{\varepsilon}{q} \cdot \frac{1}{N(w) \cdot w^2}, \qquad (5/a)$$

vagy pedig:

akkor:

$$\frac{dC}{dU_R} = \frac{\varepsilon^2}{q} \cdot \frac{1}{N(w) \cdot w^3}.$$
 (5/b)

Más formában

$$N(w) = \frac{1}{q \cdot A^2 \cdot \varepsilon} \cdot C^3 \cdot \left(\frac{dC}{dU_R}\right)^{-1}, \qquad (6/a)$$

$$w = A \cdot C^{-1} \cdot \varepsilon. \tag{6/b}$$

Mivel a kapacitásmeredekség éppúgy jól mérhető [7], mint maga a kapacitás, (6/a) és (6/b) a profil-



1. ábra. Tértöltésréteg p-n átmenetben



2. ábra. A mérhető adalékeloszlások behatárolása

meghatározás alapegyenleteit képezik. (5/b) szerint az átmenet síkjától távoleső magas adalékkoncentráció mérése nehéz, mert ehhez igen kicsiny kapacitásmeredekség tartozik. A nehézségek fokozódnak, ha az átmenet keresztmetszete is kicsiny.

A megvalósított berendezéssel az alábbi egyenlőtlenségrendszerrel behatárolt tartományba eső adalékeloszlások mérhetők:

 $N(w) \le 10^{19} \text{cm}^{-3},$ (7/a)

 $w \leq 5\mu m$, (7/b)

 $N(w) \cdot w^3 \cdot A^{-1} \leq 4.10^{21} \text{ cm}^{-3} \cdot \mu m^3 \cdot \text{cm}^{-2}$, (7/c)

$$1 \le A/A_0 \le 1000$$
, ahol: $A_0 = 10^{-4} \text{cm}^2$, (7/d)

A mérhető tartományt ábrázolja a 2. ábra.

Az ábrázolt mérési tartománynak kereken $C = (0,6 \div 600)$ pF rétegkapacitás felel meg.

GaAs-ben és Si-ban egyaránt felvehető az adalékeloszlás, mert ε értékét a berendezés változtathatóan képes figyelembe venni.

A kapacitás és kapacitásmeredekség mérésével kapcsolatos megfontolások

Mint az (5/b) egyenlet elárulja, a méréshatár bővítés kritikus iránya az átmenettől távoleső, magas adalékkoncentráció felé mutat. Ekkor ugyanis igen kis kapacitásmeredekséget kell mérnünk.

Ez kis kapacitásváltozások mérését jelenti, amelyhez célszerű kompenzációs mérési módszert választani. A mérőkapcsolás a gyakorlatban egy kapacitásmérő-híd (3. ábra). A hídágakat ellenfázisú nagy-



3. ábra. Hídkapcsolás kapacitás méréséhez

frekvenciás feszültségekkel tápláljuk. A kiegyenlítést végző ágban $C_E=C_0$, míg az ismeretlen kapacitásnak megfelelő ágban ettől ΔC -vel eltérő nagyságú kapacitás (maga a vizsgált átmenet) áll.

A híd rövidzárási kimenő árama a ΔC kapacitáseltéréssel, üresjárási kimenő feszültsége pedig a $\Delta C/C_0$ relatív kapacitáseltéréssel arányos.

A mérőhíd lezárása sohasem ilyen extrém; legfeljebb megközelíti az extrém lezárások valamelyikét:

$$(2C_0 \cdot \omega)^{-1} \ll R_{be}$$
, vagy $(2C_0 \cdot \omega)^{-1} \gg R_{be}$

Az 1 MHz-es mérőfrekvenciát és a rétegkapacitás legkisebb nyugalmi értékét (0,6 pF) figyelembe véve, könnyebb volt biztosítani, hogy:

$$R_{\rm be} \ll (2C_0 \cdot \omega)^{-1}$$
 legyen.

Mivel a rendszerint nagyobb félvezető lapkán elhelyezkedő vizsgálandó p-n átmenethez mikroszkóp alatt csatlakozunk, és a kapcsolatot a mérőkörrel koaxiális kábelek biztosítják, figyelembe kell venni a kábel fázistolását és elég nagy kapacitását is.

Ha ezt kihangoljuk, a veszteségek miatt nem keletkezik olyan nagy és stabil impedancia, amely az üresjárási feszültség vizsgálatához elegendő lenne.

Ezért a megvalósított berendezésben az érzékelő erősítő bemenő ellenállása: $R_{be} = 180$ Ohm. A mikroszkóphoz vezető kábelek hatását a híd másik ágában ekvivalens hosszúságú koaxiális tápvonal kompenzálja.

 $R_{be} = 180 \ \Omega$ mellett kereken $C_0 = 100 \text{ pF-os}$ értékéig tekinthető úgy, hogy a híd "rövidzárásban" működik. Ennél nagyobb kapacitásértékű átmenetek vizsgálatánál a híd kimenő feszültsége és a ΔC kapacitásváltozás közötti arányossági tényező már a mindenkori C_0 értéktől is függ. Ez a hatás a jelfeldolgozás egy későbbi fázisában áramkörileg kompenzálható.

Alacsonyabb R_{be} érték választása mindenképpen a híd kimenőfeszültségének csökkenéséhez vezet, mert a vizsgált átmenet nemlinearitásai miatt a hidat tápláló feszültség nem növelhető bármeddig. (Ésszerű határ pl. az U = 100 mV-os érték.) Ezért R_{be} csak addig csökkenthető, amig még a híd jelentősen nagyobb kimenő feszültséget szolgáltat, mint az erősítő bemenetre redukált zajfeszültsége.

180 Ω bemenő impedancia mellett olyan optimálisan beállított előerősítő fokozatot készítettünk, amellyel a bemenetre redukált zajfeszültség 2,1 nV×Hz^{-0,5} értékre adódott. Így néhány kHz-nyi sávszélesség mellett a legkisebb kiértékelhető jelfeszültség 300 nV nagyságú. Ebből az adódik, hogy $\Delta C = 3$ mpF már megmérhető.

Ha 1 V-ban korlátozzuk az átmenet előfeszültségének munkapont körüli variációját, amely a ΔC kapacitásváltozást létrehozza, a legkisebb megmérhető kapacitásmeredekség: 3 mpF/V-ra adódik. Ez az érték összhangban van 5*b*-vel és 7*c*-vel.

A berendezés működésének magyarázata és blokkvázlata

Egy feszültségfüggő kapacitás kapacitás-meredekségét egyszerűen megmérhetjük [7]. Ha ugyanis a 3.



4. ábra. Az adalékeloszlás-mérő blokkvázlata

ábrán rajzolt hídkapcsolásban a mérendő C_x kapacitás ΔC megváltozását az előfeszültség ismert ΔU megváltozása okozza, a híd a kapacitásmeredekséggel arányos nagyfrekvenciás áramot küld az erősítő bemenő impedanciájára. Az erősítő kimenő feszültsége pedig a kapacitásmeredekséggel lesz arányos.

Fázisérzékeny detektorral egyenirányítva ezt a feszültéget, megkülönböztethető a ΔC elhangolás iránya is.

Ha a mérendő átmenet nyugalmi tértöltéskapacitását meghatározó U_{R0} egyenfeszültségre $\Delta U \equiv U_T$ amplitudójú, alacsonyfrekvenciás (pl. 50 Hz) trapéz alakú feszültséget szuperpolálunk, ez ugyancsak trapéz-alakú kimenő feszültséget hoz létre a fázisérzékeny egyenirányító kimenetén. Ez a zérus egyenfeszültségre szimmetrikus, ha az U_{R0} előfeszültséghez tartozó nyugalmi kapacitásnál a híd a másik ágban lévő kapacitással kiegyenlített állapotban van.

Más esetben az egyenfeszültség komponens előjele azt jelzi, kisebb-, vagy nagyobb-e a kihangoló kapacitás értéke az éppen szükségesnél.

Ez az egyenfeszültség-komponens használható fel arra, hogy – zérus feszültségreferenciát alapul véve – negatív visszacsatolással automatikusan beállítsuk a szükséges kihangoló kapacitást.

Ha ez megtörtént, a kimenő trapézjel amplitudója éppen a kapacitásmeredekséggel arányos.

Szinte megvalósíthatatlan azonban olyan széles sávban lineáris és stabil erősítőt készíteni, mint amekkora a kapacitásmeredekség változásának dinamikája.

Ezért helyesebb, ha a demodulált jel amplitudóját tartjuk az U_T trapézjel visszaszabályozása által konstans értéken. Ez esetben U_T a kapacitásmeredekséggel fordítottan arányos lesz. Ha az indikátorerősítő erősítését a mért dióda felületével fordított arányban szabályozzuk, és a demodulált jel amplitudóját ε^2 -vel arányos konstans értéken tartjuk, az:

$$U_{\tau} = \text{Konst} \cdot N(w) \cdot w^3 \tag{8}$$

összefüggés adódik.

A w-vel arányos feszültséget egy olyan négypólus szolgáltatja, amelynek transzfer feszültségkarakterisztikája nagy pontossággal a kihangoló ágban elhelyezett kapacitásdióda $C_0(U_R)$ karakterisztikájával fordítottan arányos. Ha a négypólus bemenő feszültsége az automatikus kihangoló feszültség, és a kimenő feszültségét (ε ·Ai)-val fordítottan arányos osztóra visszük, a szolgáltatott feszültségről kimutatható, hogy

$$V_{w} = \text{Konst} \cdot w.$$
 (9)

 U_T és U_w értékéből állítja elő a berendezés analóg aritmetikai egysége a koncentráció logaritmusával (lgN(w)) és helyével (w) arányos feszültségeket. Ezek x-y rajzolót vezérelnek.

Mérés közben a vizsgált átmenet előfeszültsége végigfut a beállított kezdőérték és végérték között. Eközben a kihangoló ágbeli kapacitásdióda automatikus előfeszültsége fenntartja a mindenkor szükséges kihangoló kapacitást.

Mivel azonban a híd mindkét ágában változó veszteségű elektronikus kapacitás áll, komoly zavarok elkerülése érdekében a veszteségek automatikus kiegyenlítéséről is gondoskodni kellett.

Ezért a fázisérzékeny detektálást nemcsak magán

365

HÍRADÁSTECHNIKA XXX. ÉVF. 11-12. SZ.

a jelen, hanem annak 90° -kal késleltetett alakján is elvégeztük, egy-egy mintavételes áramkörrel.

Ez utóbbi eredménye a fázishiba szinuszával arányos hibafeszültség, amely negatív visszacsatolásban a híd egyik ágában elhelyezett diódás fázistolót vezérel.

A szabályozások követő jellegűek, PID-kompenzáltak és a "kiakadások" elkerülésére nem lineárisak.

A berendezés blokkvázlata a 4. ábrán látható.

IRODALOM

 Möschwitzer, A.: Parameter und Grenzwerte bipolarer Transistoren für hochintegrierte Schaltkreise. (Rep. I. -78.) Privát közlemény.

[2] A. Ambrózy: Periodica Polytechnica, Electrical Engineering, Vol. 20. No. 2. 141-155. 1976.
[3] B. Szentpáli, Híradástechnika, 29. 335-341. 1978.
[4] M. Simek, and al., TÁKI Évkönyv, 1975. 227-244. 1975.
[5] E. Nagasawa, and al., Sol. State El. 20. 507-513. 1977.
[6] C. Opdorp., Sol. State El. 11. 397-406. 1968.

[7] A. Ambrózy, Sol. State El. 13. 347-353. 1970.